

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 26 年 3 月 13 日 (2014.3.13)

【公開番号】特開 2012-159464 (P2012-159464A)
 【公開日】平成 24 年 8 月 23 日 (2012.8.23)
 【年通号数】公開・登録公報 2012-033
 【出願番号】特願 2011-20926 (P2011-20926)
 【国際特許分類】

G 0 1 R 33/26 (2006.01)

A 6 1 B 5/05 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 33/26

A 6 1 B 5/05 A

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 1 月 29 日 (2014.1.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ポンプ光により励起される原子からなる原子群を含むセルを複数有するセルアレイと、
 前記セルアレイの各セルに対してポンプ光を照射する第 1 照射手段と、
 前記各セルに対し、当該セルに対して照射される前記ポンプ光と当該セル内で交差する
 ようにプローブ光を照射する第 2 照射手段と、
 前記各セルを透過した前記プローブ光を各々受光して前記各セルにおける磁場を検出す
 る検出手段と、
 前記各セルに対応して設けられ、入力された制御信号に従って、前記第 1 照射手段で照
 射された前記ポンプ光が当該セルに入射する光量を調整する調整手段と、
 前記セル毎に、前記ポンプ光の光量の調整量を記憶する記憶手段と
 を備え、
 前記調整量に基づいて前記第 1 照射手段の照射量を調整する
 ことを特徴とする磁場計測装置。

【請求項 2】

前記各セルに対応して設けられ、制御信号に従って前記ポンプが前記セルに入射する光
量を調整する調整手段を備える
ことを特徴とする請求項 1 に記載の磁場測定装置。

【請求項 3】

前記各セルに対して一定の磁場を印加すると共に、前記制御信号を変化させて前記調整
手段に入力し、前記磁場検出手段で検出される前記各セルの磁場の検出値が予め定められ
た基準値となるときの前記制御信号を前記セル毎に特定し、特定した前記セル毎の前記制
御信号に基づく前記調整量を前記記憶手段に記憶させる特定手段を備える
ことを特徴とする請求項 2 に記載の磁場計測装置。

【請求項 4】

前記第 1 照射手段は、前記セルアレイにおける複数のセルに対して一の前記ポンプ光の
 光源を有し、当該光源から前記複数のセルに対して前記ポンプ光を分配して照射する
ことを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれか一項に記載の磁場計測装置。